

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!



Коллектив Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины и редколлегия журнала «Автоматическая сварка» горячо и сердечно поздравляют Игоря Витальевича Кривцуна с избранием в действительные члены НАН Украины и Владимира Михайловича Нестеренкова — в члены-корреспонденты НАН Украины. Желаем им доброго здоровья, счастья, новых достижений и дальнейших творческих успехов!



Справка

И. В. Кривцун окончил физический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко; с 1976 г. работает в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, с 2004 г. — заведующий отделом физики газового разряда и техники плазмы, с 2008 г. — заместитель директора по научной работе; кандидат физико-математических наук по специальности «Теоретическая и математическая физика» (1987 г.), доктор технических наук по специальности «Электротермические процессы и установки» (2003 г.), член-корреспондент Национальной академии наук Украины по специальности «Материаловедение, сварка металлов» (2006 г.); автор более 170 научных трудов, в том числе трех монографий и семи патентов.

И. В. Кривцун — широко известный ученый в области физики газового разряда и теории сварочных процессов, внесший выдающийся вклад в развитие указанных научных направлений. Его основные работы посвящены исследованию физических явлений, протекающих в низкотемпературной технологической плазме (сварочные дуги, плазменные струи, оптический и другие виды газового разряда), а также процессов взаимодействия электродуговой плазмы и лазерного излучения с обрабатываемым материалом в условиях дуговой, плазменной, лазерной и гибридной сварки, наплавки и нанесения покрытий.

Наряду с плодотворной научной деятельностью И. В. Кривцун ведет большую педагогическую и научно-организационную работу. В 2009 г. он стал профессором кафедры лазерной техники и физико-технических технологий НТУУ «КПИ», а с 2010 г. является заведующим этой кафедрой; руководит аспирантурой и докторантурой при Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины; им подготовлены два кандидата и один доктор наук. Он является постоянным членом специализированных советов по защите диссертаций при НТУУ «КПИ» и при ИЭС им. Е. О. Патона, членом редколлегии журнала «Автоматическая сварка». И. В. Кривцун — действительный член Американского сварочного общества (AWS), член Информационного общества по материалам (ASM International); активно сотрудничает с различными научно-техническими организациями Германии, России, США, Китая и других стран.

В. М. Нестеренков окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности «Технология и оборудование сварочного производства»; с 1973 г. работает в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины; в 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2004 г. — докторскую в области электронно-лучевой сварки металлов большой толщины; в настоящее время ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отдела исследования физических процессов, технологии и оборудования для электронно-лучевой и лазерной сварки, лауреат Государственной премии Украины 2006 г.

В. М. Нестеренков — известный ученый, внесший существенный вклад в развитие теоретических основ физико-металлургических процессов при электронно-лучевой сварке металлов большой толщины и определение критериев стабильного поведения сварочной ванны в разных пространственных положениях. Им исследованы гидродинамические процессы в парогазовых каналах большой глубины, разработаны технологические процессы сварки низколегированных сталей толщиной до 200 мм и высокопрочных алюминиевых сплавов толщиной до 300 мм. В. М. Нестеренков предложил научно обоснованные рекомендации по применению параллельного сканирования луча и пространственной ориентации сварного стыка при электронно-лучевой сварке крупногабаритных изделий ответственного назначения, а также целесообразность модификации металла швов с целью повышения прочности и эксплуатационной надежности соединений. С использованием научных достижений В. М. Нестеренкова были выполнены работы по 25 контрактам с фирмами «Framatome», «Aerospatiale» (Франция), «Airbus» (Англия), HBC, WBC (Китай) и «K+S Services» и «Alcoa» (США).

Основные положения научных исследований В. М. Нестеренкова опубликованы в 72 работах, включая 12 авторских свидетельств, докладывались и обсуждались на многочисленных международных конференциях по электронно-лучевым технологиям.